

超高速 EBSD 受託分析のご提案

解像度そのまま！ 3000 点 / 秒測定が可能！！

CMOS センサー搭載の超高速 EBSD 検出器で、**広範囲** なデータをより **短時間** で取得可能となりました。
素早い分析対応や複数試料立会分析など、皆様のニーズに合った分析をご提供します！

- ★ 一回の立会分析でもっとたくさんの試料を依頼したい
- ☆ より短納期で受託分析をして欲しい
- ★ これまでと同等の測定時間でより広範囲な像や解像度の高い像が欲しい etc.

ご利用料金：1 日につき ¥500,000 WEB 立会い分析も可能です！

※ より短時間での利用も可能です。詳細はお問い合わせください。

二相ステンレスの測定例

従来

Velocity

25sec では
ここで終了



AccV. : 15kV
Probe Curr. : 5.5nA
Scan Area : 80μm×160μm
Step Size : 0.4μm

Total Time : 25sec

Total Point : 92,631

**測定スピード
約 100 倍**

※ 上記条件における従来検出器との測定
スピードの差（各種条件設定により、この
数値は変わります）

IPF map

IPF map

IPF map(BCC)

IPF map (FCC)

従来の検出器では測定が終わらない条件でも Velocity ならこのクオリティ！

EBSD とは後方散乱電子回折（Electron BackScatter Diffraction : EBSD）のことで、SEM に組み合わせてミクロな結晶方位や結晶系を測定します。結晶粒毎の情報が得られ、結晶方位データから、結晶粒の方位分布＝集合組織や結晶相分布を解析できます。

JEOL EBSD

Velocity（以下 TSL ソリューションズ社資料より一部引用）

検出器：低ノイズ高速動作 CMOS センサー（Vision Research 社製）

CMOS センサー画素数：640×480（120×120 イメージはカメラ内 Binning 処理）

測定速度：>3000 点 / 秒（画素数 120×120 条件にて）

反射電子検出器：PRIAS 法反射電子像表示機能標準装備

EDS-EBSD 同時検出：>3000 点 / 秒での高速自動取り込み可

ChiScan による高精度の Phase Map を実現

測定ソフトウェア：TEAM および APEX

※ 受託分析については、JSM-7900F でのサービスご提供となります）

※ 「Velocity」は TSL ソリューションズ社の登録商標です。

